

でんし けんび きょう

電子顕微鏡

Scanning Electron Microscopy (略称:SEM)

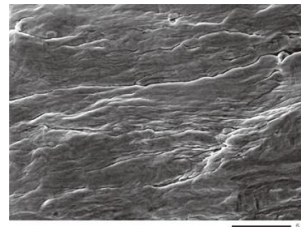
日本電子製 / JSM-IT500LA

用途・特徴

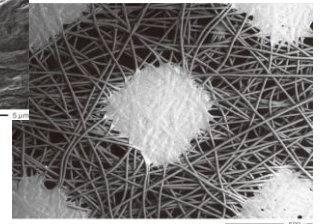
各種工業材料の表面を高倍率・
高精細に観察、元素分析する装置。

低真空モードにより、非導電性
材料も観察・分析可能。

製品上の汚れや異物、破損・欠
陥の調査等に有効。



ステンレス鋼疲労破面
×5,000



×50
不織布マスク

出典：日本電子株式会社ホームページより

仕様・性能

分解能	3.0nm (高真空、30kV) 4.0nm (低真空、30kV BED)
倍率	30 ~ 300,000倍
電子銃	W (タングステン) フィラメント
加速電圧	0.3 ~ 30kV
最大試料寸法	直径 50mm × 高さ 25mm
検出器	エネルギー分散型X線分析 (EDS) 装置
検出可能元素	Be (ベリリウム) ~ U (ウラン)
分析モード	点、線、面

利用料金：940円/時間 (市外 1,880円/時間)